

学校・研究機関のみなさま

アカデミックカタログ

2020年度

フィルメトリクス株式会社では、長年に亘り光学式膜厚測定装置を販売し、国内の大学・官公庁をはじめとする研究機関や、半導体・化学材料・医療・自動車関連等様々な企業で御使用頂いております。

膜厚測定システム

F20

世界中で 5000 台以上使用されているベーシックモデルのアカデミック版です。



F20e

- 膜厚測定範囲 15nm ~ 70μm

F20e-UV

- 膜厚測定範囲 1nm ~ 40μm

F20e-UVX

- 膜厚測定範囲 1nm ~ 250μm

価格 アカデミック特別価格

顕微鏡式自動マッピング膜厚測定システム

F54-XY

フォーカス、XYの移動、ベースラインを全て自動化、サンプルを置くだけで膜厚分布が測定できます。



新製品

F54-XY-200

- 膜厚測定範囲 20nm ~ 40μm (5倍対物レンズ)
- XY自動ステージ 200mm × 200mm
- 高速測定 25ポイント/14秒

価格 アカデミック特別価格

サンプル測定のご案内

- ※ 測定膜厚範囲は、膜材料など、サンプルの条件によって異なります。
- ※ サンプル測定を実施しております。御見積書・御購入の前に、測定の可否、装置仕様のご確認をお願いいたします。

フィルメトリクス株式会社

資料請求等のお問合せ先は

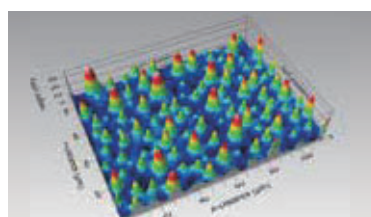
メール : info@filmetrics.co.jp

3次元表面形状測定システム

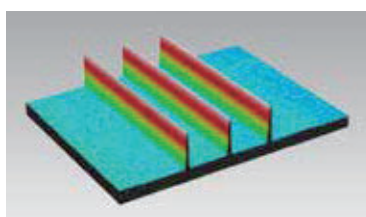
表面形状・段差・粗さ測定システムを身近に！

1台でナノオーダーの表面粗さからミリオーダーの形状段差測定まで可能です。

段差測定範囲	～ 10 mm
段差測定正確性	0.7%
XY 分解能	最小 0.4μm
測定ステージ	100×100 mm 200×200 mm



ポリマー混合物の3次元形状



導波路型回折格子

Profilm3D

FILMETRICS
A KLA Company

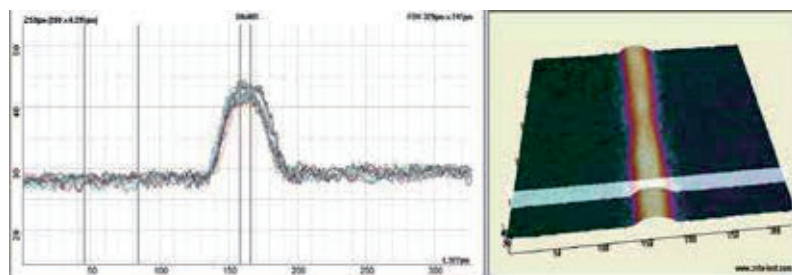


価格 アカデミック特別価格

マルチ共焦点顕微鏡システム

独自の ZDot™ テクノロジーで高速測定！

非接触で段差・粗さ・寸法の測定結果を True Color 画像で表示します。デュアル光源を搭載し、高反射率部と低反射率部を同時に測定できます。



太陽電池サンプル

反射率が95%の銀電極部と、1%以下の黒いセル部を同時に測定

Zeta-20

KLA+
INSTRUMENTS



価格 アカデミック特別価格

FILMETRICS
A KLA Company

フィルメトリクス株式会社

〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-5-9 新横浜フジカビル8F Tel : 045-473-7109

Email : info@filmetrics.co.jp URL : www.filmetrics.co.jp